MICROCRE 研润光机

ZMP-1000ZS 金相试样磨抛机

产品资料摘要

型号 ZMP-1000ZS 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

ZMP1000ZS智能薄片自动 抛光机 ，是专为超薄型工件，如超薄的金属片、陶瓷片、玻璃片、岩石片、新兴电子器件等，以及特殊样件如LED芯片板等，研发的一款自动研磨抛光机。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
PLC智能控制系统	8寸彩色触摸屏、PLC控制系统，智能化操作界面。
智能辅料添加系统	两路智能控制研磨辅料的添加，单次加料时间、加料间隔时间任意设定。
智能磨抛方案系统	100种智能磨抛方案存储，为您提供正确的试样研磨抛光方案。
真空吸附平台系统	真空吸附平台可对超薄件、金属件、非金属件等进行吸附式固定。
磨抛压力控制系统	气动加载压力，PLC系统自动调节压力。
多种工作方式选择	智能磨抛、手动磨抛。

参数项目	原站列示数值或说明
机体形式	台式
控制方式	8寸彩色触摸屏，PLC控制系统
磨抛方式	智能/手动 双重模式
磨抛方案	智能存储，最多可存储100种磨抛方案
压力加载	气动加压，自动调控
磨料添加	双智能加料系统
加料间隔	智能设定，最小加料间隔0.1S
喷料时间	智能设定，最小喷料时间0.1S
压力范围	1-200N
磨样时间	0-9999秒

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/ZMP-1000ZS.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。